Реєстраційна картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0116U002856

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 26-04-2016

II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки ()

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

У тому числі по роках:	
2016	300 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування: 300 тис. грн.	

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи: Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442346674, 380442262347, 380442396594, 380442343243

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи: Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: пр. Науки, 41, м. Київ, Київська обл., 03028, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380445254020

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка технології виготовлення сенсорних чіпів з підвищеною чутливістю та покращеними фізико - механічними характеристиками для оптичних сенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансу (ППР)

Назва роботи англійською:

Development of technology for production of sensor chips with increased sensitivity and improved physical - mechanical characteristics of for the optical sensors based on surface plasmon resonance (SPR)

Мета роботи українською:

Розробка та оптимізація технологічних процесів інтерференційної фотолітографії з використанням вакуумних фоторезистів для виготовлення сенсорних чіпів з підвищеною чутливістю та покращеними характеристиками для оптичних сенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансу (ППР). Буде виготовлено та випробувано експериментальну партію структурованих сенсорних чіпів та дослідний зразок ППР рефрактометра.

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Інше

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Технології

Галузь застосування: Приладобудування

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Індутний Іван Захарович

Науковий ступінь: д. ф.-м. н.

Наукове звання: професор

Ідентифікатор ORCHID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка технології виготовлення сенсорних чіпів з підвищеною чутливістю та покращеними фізико - механічними характеристиками для оптичних сенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансу (ППР)

Початок етапу: 04.2016

Закінчення етапу: 12.2016

Вид звітного документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 621.396.6:658.562; 621.396.66, 681.586.5; 681.785.552

Коди тематичних рубрик: 47.13.35

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Бєляєв Олександр Євгенович
д. ф.-м. н., 01.04.10

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності Юрченко Т.А.